



円盤用表面形状測定装置 NANOMETRO[®] 700 F R

黒田精工株式会社

NANOMETRO *FR* series

可对应各种符合
平板尺寸的装置系列

NANOMETRO 1000FR

NANOMETRO 900FR

NANOMETRO 700FR



NANOMETRO 700 F R 的特点

世界上第一个行业标准

可以评价到 $\Phi 700$ mm的表面形状（平面度）

高精度移动机构

综合测量精度 $0.4 \mu\text{m}$

根据使用目的可以选择评价方式

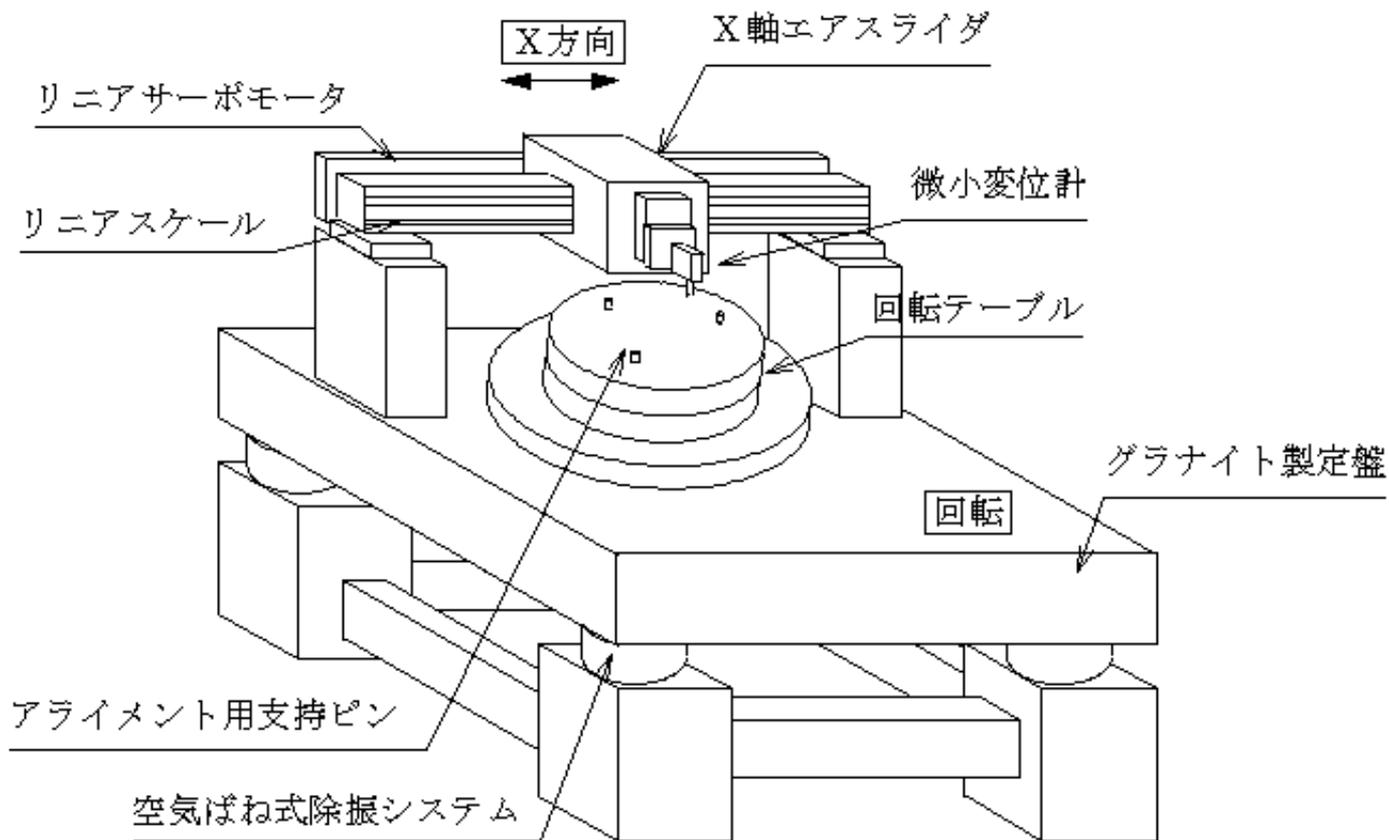
详细评价 同心圆测量

概略评价 放射形状测量

丰富的分解机能

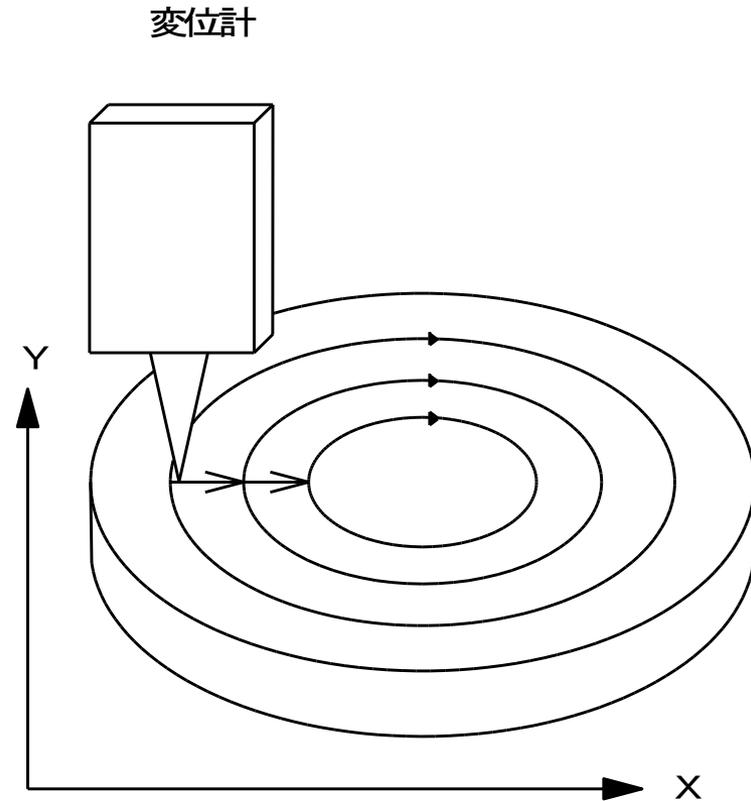
根据客户的要求，制作适当的分解软件

構造図



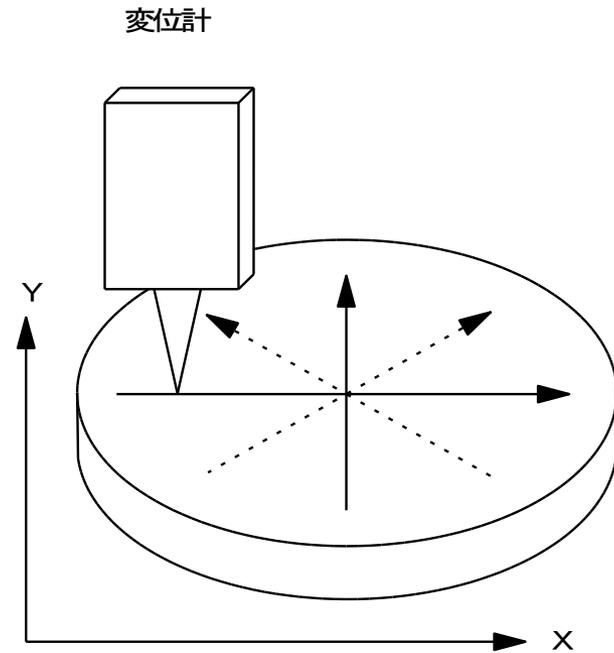
同心圆测量方法

通过同心圆的测量方式，
可以量测在设定的量测
范围内，评价平面度。

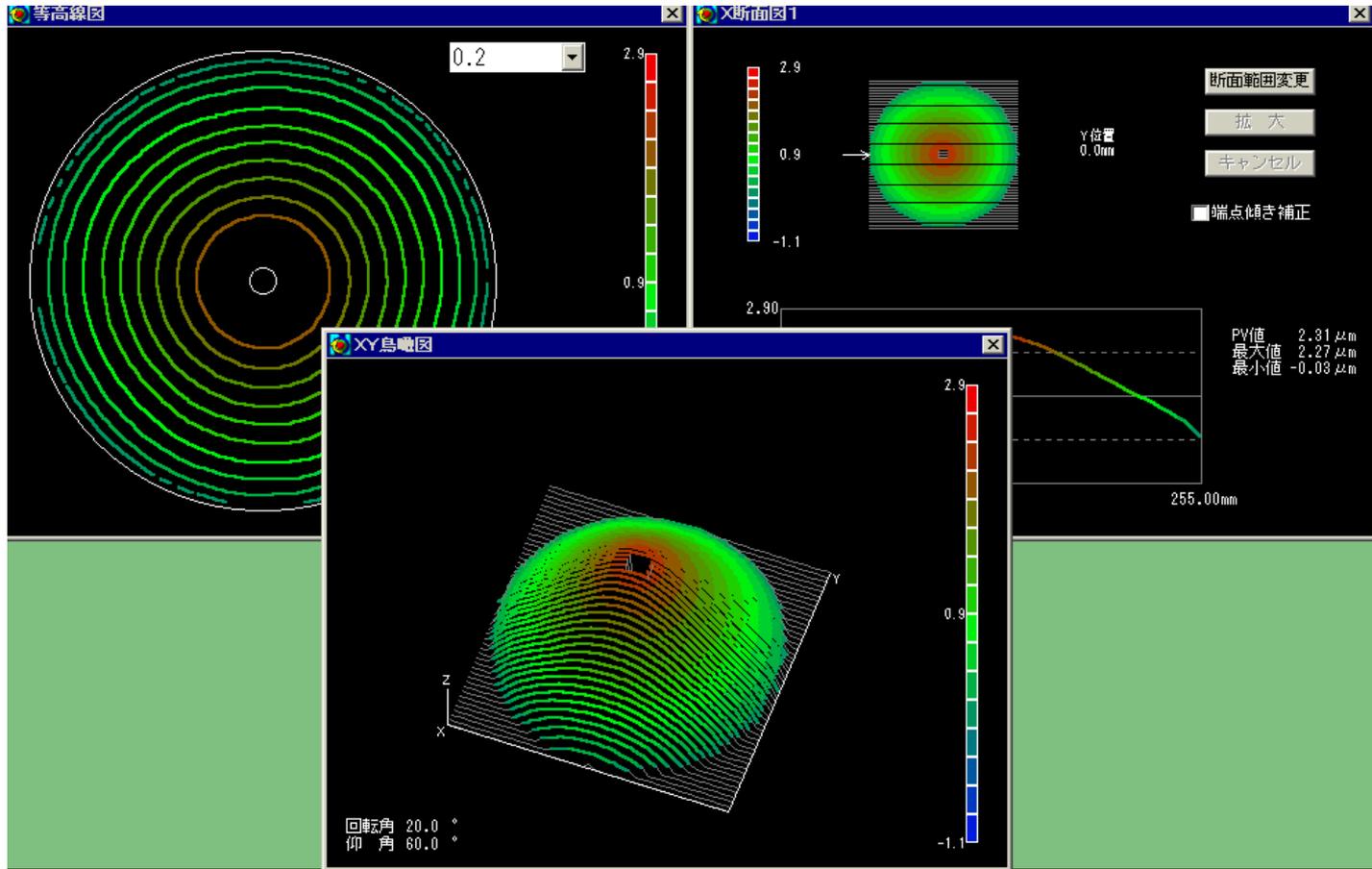


放射形状测量方法

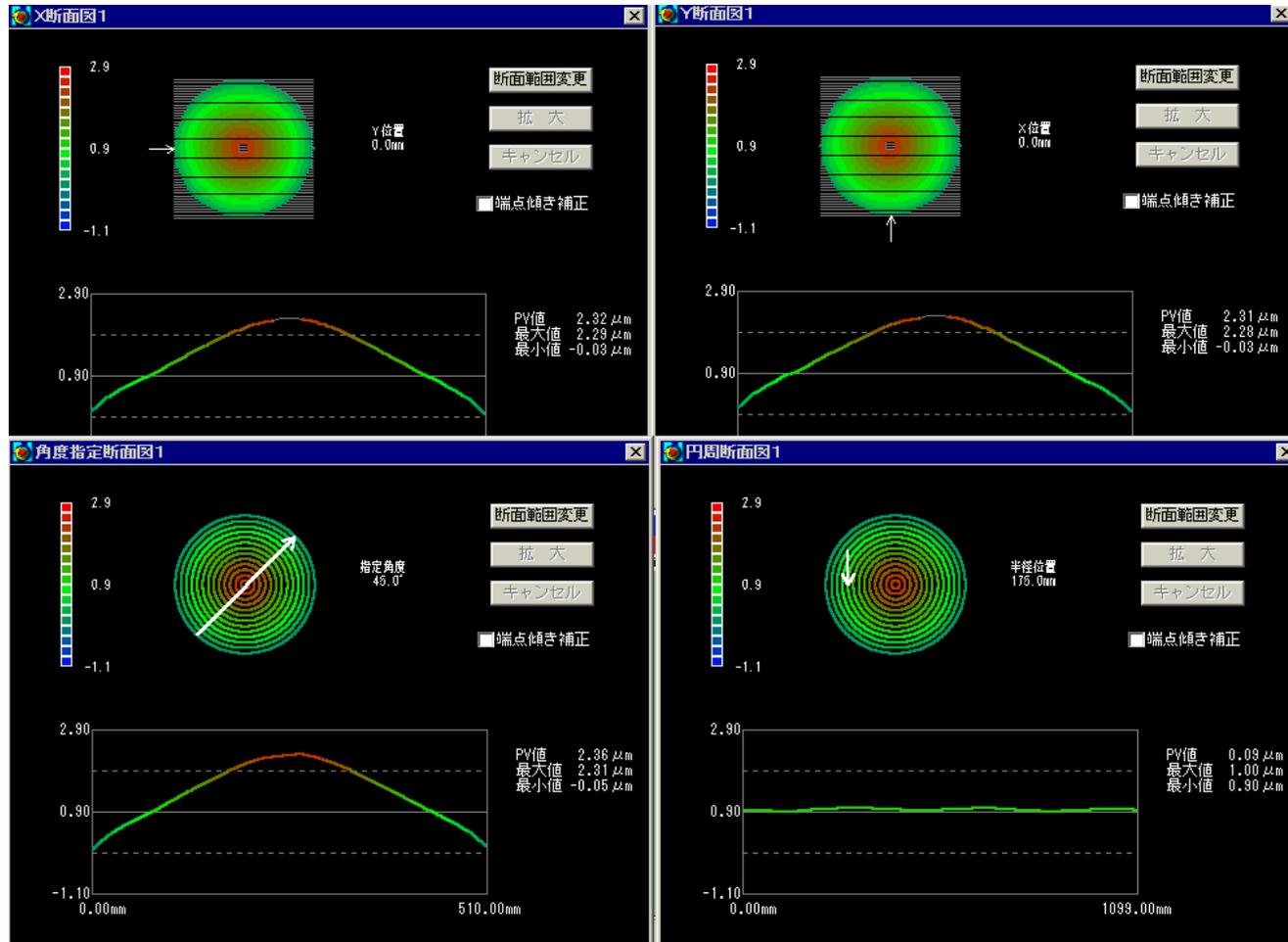
通过放射形状测量方式，
从任意设定的角度可以
量测。最合适于概略评价。



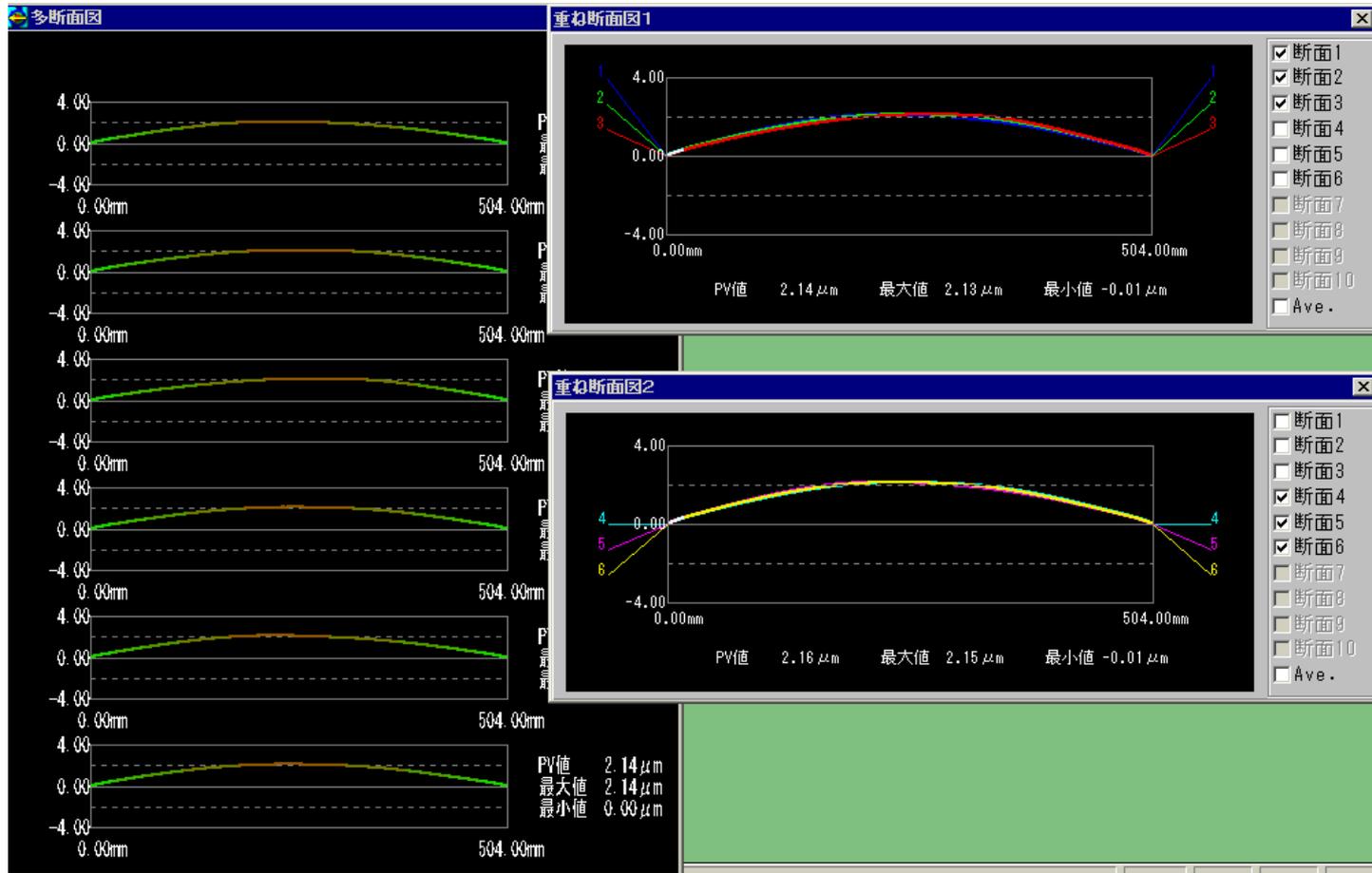
鳥瞰図



等高线图・断面分析例



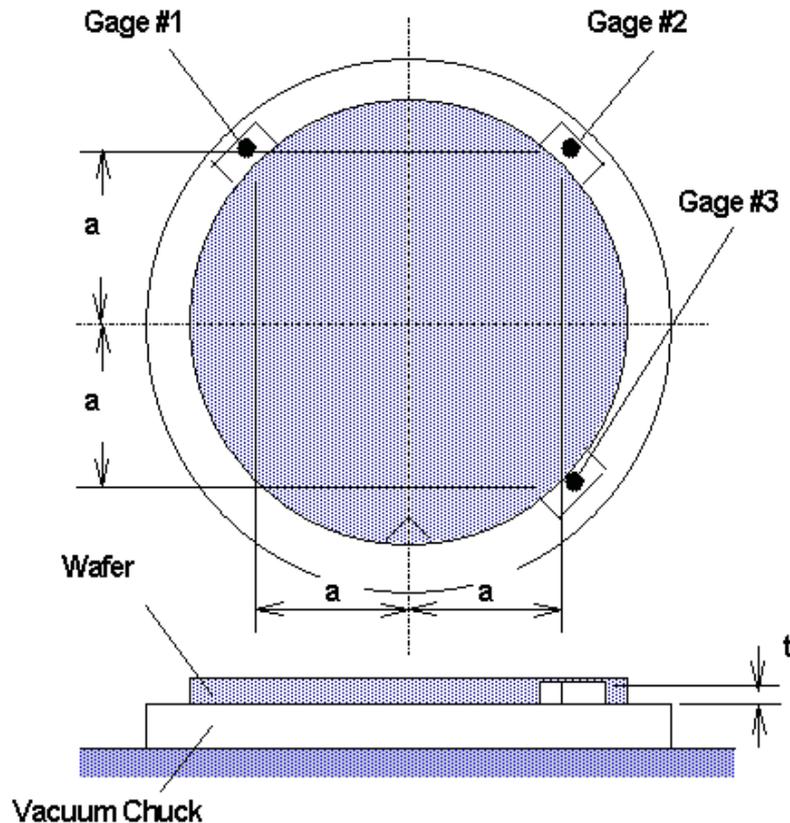
放射形状测量例



晶片(wafer)的平坦度测量方法

测量方法

- 1) 在测量晶片的平台上附有3处「高度基准」量规
- 2) 将晶片表面对准于高度基准量规面的3处, 进行测量。
- 3) 评价「真空吸盘基准」的「厚度」与「平坦度」。



ウエーハ測定用定盤 (バキュームチャック)

700FR 主要规格

测量范围	$\phi 700\text{mm}$
综合测量精度	$0.4\mu\text{m}$
重复测量精度	$0.05\mu\text{m}$ (σ)
显示分解能力	$0.01\mu\text{m}$
测头	電気千分尺
最大工件重量	60 kg